# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-015698

(43)Date of publication of application: 18.01.2002

(51)Int.CI.

H01J 49/04 GO1N 27/62 H01J 49/10 // GO1N 30/72

(21)Application number : 2000-198226

(71)Applicant: JEOL LTD

(22)Date of filing:

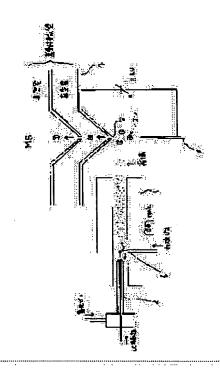
30.06.2000

(72)Inventor: KOBAYASHI TATSUJI

# (54) ATMOSPHERIC CHEMICAL IONIZING ION SOURCE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an atmospheric chemical ionizing ion source by which sprayed sample droplets can be dried (solvent removal) with good efficiency even when the pass of a cylindrical heater is not elongated.

SOLUTION: A spray nozzle for spraying a liquid sample is arranged in a spraying chamber building in a heating means, and dry gas is blow against droplets of the liquid sample sprayed from the tip of the spray nozzle.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

11.04.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-15698 (P2002-15698A)

(43)公開日 平成14年1月18日(2002.1.18)

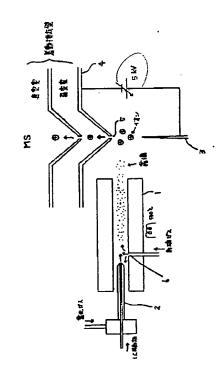
| (F1) 1 . (F1)             | althrian m                  |   |                 |
|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> | 酸別記号                        | F I デーマコート*(参考)                         |                 |
| H01J 49/04                | •                           | H01J 49/04                              | 5 C 0 3 8       |
| G01N 27/62                |                             | G01N 27/62                              | F               |
|                           |                             |   | x               |
| H 0 1 J 49/10             |                             | H 0 1 J 49/10                           |                 |
| # G 0 1 N 30/72           |                             | G 0 1 N 30/72                           | A               |
|                           |                             | 審查請求 未請求 請求                             | 頃の数4 OL (全 5 頁) |
| (21)出願番号                  | 特願2000-198226(P2000-198226) | (71)出願人 000004271                       |                 |
|                           |                             | 日本電子株式会                                 | 会社              |
| (22)出顧日                   | 平成12年6月30日(2000.6.30)       | 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号                        |                 |
|                           |                             | (72)発明者 小林達次                            |                 |
|                           |                             | 東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号 日本                     |                 |
|                           |                             | 電子株式会社内                                 |                 |
|                           |                             | Fターム(参考) 50038 EED2 EF04 EF26 GC08 CH05 |                 |
|                           |                             | GH08                                    |                 |
|                           |                             | die                                     | 8               |
|                           |                             |   |                 |
|                           |                             |   | •               |
|                           |                             | •                                       |                 |
|                           | ·                           |   |                 |
|                           |                             |   |                 |
|                           |                             |   |                 |
|                           |                             |   |                 |

### (54) 【発明の名称】 大気圧化学イオン化イオン源

### (57)【要約】

【課題】筒状ヒーターのパスを長く取らなくても、霧化 した試料液滴を効率良く乾燥(脱溶媒化)させることの できる大気圧化学イオン化イオン源を提供する。

【解決手段】加熱手段を内蔵した霧化室内に、液体試料を霧化するための霧化ノズルを配置すると共に、該霧化ノズルの先端部から噴出される液体試料の霧滴に対して、乾燥ガスを吹き付けるようにした。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】加熱手段を内蔵した霧化室内に、液体試料を霧化するための霧化ノズルを配置すると共に、該霧化ノズルの先端部から噴出される液体試料の霧滴に対して、乾燥ガスを吹き付けるようにしたことを特徴とする大気圧化学イオン化イオン源。

【請求項2】前記加熱手段を内蔵した霧化室は、筒状を したヒーターであることを特徴とする請求項1記載の大 気圧化学イオン化イオン源。

【請求項3】前記乾燥ガスの吹き出し口は、霧化ノズル 10 先端部の近傍に開口していることを特徴とする請求項1 または2記載の大気圧化学イオン化イオン源。

【請求項4】前記乾燥ガスは、加熱手段により予め加熱されていることを特徴とする請求項1、2、または3記載の大気圧化学イオン化イオン源。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、質量分析法で用いられる大気圧化学イオン化イオン源に関し、特に、霧化した試料液滴を、効率良く乾燥(脱溶媒化)させること 20のできる大気圧化学イオン化イオン源に関する。

[0002]

【従来の技術】クロマトグラフ装置と質量分析装置を結合させたクロマトグラフ/質量分析装置では、クロマトグラフ部で分離された成分をイオン化して質量分析部に与えるインターフェイスが必要である。このインターフェイスとして、液体クロマトグラフ/質量分析装置では、エレクトロスプレー・イオン源や大気圧化学イオン化イオン源などの大気圧イオン化イオン源が使用されている。

【0003】エレクトロスプレー・イオン源では、液体 試料を細いノズルの先端に送り、そのノズルの先端に高 電圧を印加する。これにより、ノズル先端には強い不平 等電界が形成され、との強い電界により液体試料が帯電 液滴として噴霧され、更に、液滴内でのイオンのクーロン反発により液滴の分裂が進行して、イオン化が行なわれる。一方、大気圧化学イオン化イオン源では、ネブライザー(霧化器)においてガス流により液体試料を強制 噴霧し、これを加熱することにより液滴の乾燥(脱溶媒化)を行なった後、コロナ放電により生成したバッファイオンと衝突させて試料のイオン化(化学イオン化)を行なう。

【0004】エレクトロスプレー・イオン源は高極性イオンに適したインターフェイスであり、一方、大気圧化学イオン化イオン源は中〜低極性のイオンに適したインターフェイスであるというように、両者は相補的な関係にある。液体クロマトグラフ/質量分析装置が対象とする化合物は非常に多岐にわたるため、或る試料についてはエレクトロスプレー・イオン源を使用し、他の試料については大気圧化学イオン化イオン源を使用するという

ように、両者を使い分ける必要がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、大気圧化学イオン化イオン源を使用するに当たって大切なことは、液体クロマトグラフ装置などから送られてくる液体試料を液滴として大気中に分散させた後、その液滴に含まれる溶媒分子をいかに効率良く取り去って試料のイオン化を達成するか、ということである。

【0006】図1は、従来の大気圧化学イオン化イオン源を示したものである。図中1は霧化室を兼ねた筒状ヒーターである。筒状ヒーター1を予め400~500℃に加熱しておき、図示しない液体クロマトグラフ装置からの試料を含んだ移動相を、ヒーター穴に対してほぼ同心・同軸状に設置された霧化ノズル2の先端部から、窒素ガスなどの霧化ガスと共に勢い良く送り出して霧化させる。霧化された試料液滴(移動相)は、加熱されたヒーター穴を通過するうちに、筒状ヒーター1の内壁から輻射熱をもらい、徐々に乾燥(脱溶媒化)されていく。そして、霧化ガスの流れに乗って下流に向けて押し流され、筒状ヒーター1の内壁面には直接衝突することなく、質量分析計の近傍まで運ばれる。

【0007】筒状ヒーター1の軸線と、針状電極3と質量分析装置の対向電極4上に設けられたサンプリング・オリフィス5とを結ぶ軸線とは、互いに90 に直交している。針状電極3と対向電極4の間には5kV程度の電位差が設けられ、両電極間にはコロナ放電が発生している。このコロナ放電によって励起されたガス分子は、バッファイオンとして働き、筒状ヒーター1で乾燥(脱溶媒化)された試料液滴と衝突する際に、試料のイオン化(化学イオン化)が行なわれる。そして、生成した試料イオンは、針状電極3と対向電極4の間に発生する電界の作用と、質量分析装置の真空室と外界の間の真空差圧とにより、サンプリング・オリフィス5から質量分析計の真空室内に向けて吸い込まれる。

【0008】とのような構成において、従来の大気圧化学イオン化イオン源の問題点は、霧化ノズル2から噴出する試料液滴を良く乾燥(脱溶媒化)させるためには、筒状ヒーター1からの輻射熱を受け取るための十分に長いバスが必要であり、短いパスでは霧化された液滴の乾燥(脱溶媒化)が完全には行なえなかったことである。その結果、液滴の乾燥(脱溶媒化)が不十分なまま、試料液滴が質量分析計に導入されてしまい、質量分析計内でイオンビームが安定しづらいという問題が起きていた。

【0009】また、乾燥(脱溶媒化)のためのバスを長く取ると、それだけ筒状ヒーター1の長さが長くなり、大気圧化学イオン化イオン源が大型化してしまうという問題があった。また、バスが長いと、試料成分が拡散して感度が低くなったり、試料成分の熱分解の可能性が高くなったりするという問題があった。

10

【0010】更に、ヒーター穴の内部に、ヒーター穴の 出口方向に向けてガスの定常的な流れができ、筒状ヒー ター1と霧化ノズル2の隙間から外界のバックグラウン ド成分をヒーター穴の内部に引き込んで、マススペクト ル上にバックグラウンドピークが出やすくなったりする といった問題もあった。

【0011】本発明の目的は、上述した点に鑑み、筒状 ヒーター1のパスを長く取らなくても、霧化した試料液 滴を効率良く乾燥(脱溶媒化)させることのできる大気 圧化学イオン化イオン源を提供することにある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】との目的を達成するた め、本発明にかかる大気圧化学イオン化イオン源は、加 熱手段を内蔵した霧化室内に、液体試料を霧化するため の霧化ノズルを配置すると共に、該霧化ノズルの先端部 から噴出される液体試料の霧滴に対して、乾燥ガスを吹 き付けるようにしたことを特徴としている。

【0013】また、前記加熱手段を内蔵した霧化室は、 筒状をしたヒーターであることを特徴としている。

【0014】また、前記乾燥ガスの吹き出し口は、霧化 20 ノズル先端部の近傍に開口していることを特徴としてい る。

【0015】また、前記乾燥ガスは、加熱手段により予 め加熱されていることを特徴としている。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の 実施の形態を説明する。図2は、本発明にかかる大気圧 化学イオン化イオン源の一実施例を示したものである。 図中1は霧化室を兼ねた筒状ヒーターである。筒状ヒー ター1を予め400~500℃に加熱しておき、図示し ない液体クロマトグラフ装置からの試料を含んだ移動相 を、ヒーター穴に対してほぼ同心・同軸状に設置された 霧化ノズル2の先端部から、窒素ガスなどの霧化ガスと 共に勢い良く送り出して霧化させる。霧化された試料液 滴(移動相)は、加熱されたヒーター穴を通過するうち に、筒状ヒーター1の内壁から輻射熱をもらい、徐々に 乾燥 (脱溶媒化) されていく。そして、霧化ガスの流れ に乗って下流に向けて押し流され、筒状ヒーター1の内 壁面には直接衝突することなく、質量分析計の近傍まで 運ばれる。

【0017】霧化ノズル2の近傍の筒状ヒーター1の内 壁には、窒素ガスなどの乾燥ガスをヒーター穴に供給す るための乾燥ガスノズル6が開口している。そして、予 めヒーターなどの加熱手段により加熱された乾燥ガス が、霧化ノズル2の噴出方向とほぼ垂直な方向から、霧 化された試料液滴に対して吹き付けられる。その結果、 試料液滴を含む音速に近い霧化ガスと、それに対して垂 直方向から吹き付けられる加熱された乾燥ガスとが、ヒ ーター穴の内部で激しくぶつかりあい、試料液滴の乾燥 により、ヒーター穴の内部は多少加圧雰囲気になってい るので、筒状ヒーター1と霧化ノズル2の隙間から外界 のバックグラウンド成分をヒーター穴の内部に引き込ん で、マススペクトル上にバックグラウンドピークが出る といった問題はほとんど発生しない。

【0018】筒状ヒーター1の軸線と、針状電極3と質 量分析装置の対向電極4上に設けられたサンプリング・ オリフィス5とを結ぶ軸線とは、互いに90°に直交し ている。針状電極3と対向電極4の間には5kV程度の 電位差が設けられ、両電極間にはコロナ放電が発生して いる。とのコロナ放電によって励起されたガス分子は、 バッファイオンとして働き、筒状ヒーター1で乾燥(脱 溶媒化)された試料液滴と衝突する際に、試料のイオン 化(化学イオン化)が行なわれる。そして、生成した試 料イオンは、針状電極3と対向電極4の間に発生する電 界の作用と、質量分析装置の真空室と外界の間の真空差 圧とにより、サンプリング・オリフィス5から質量分析 計の真空室内に向けて吸い込まれる。

【0019】尚、上記実施例では、乾燥ガスの吹きつけ 方向は、霧化ノズル2の噴出方向に対してほぼ垂直にな るように設定したが、これは、必ずしも垂直に限定され るものではない。また、上記実施例では、霧化ノズル2 の位置は、乾燥ガスノズル6の位置に対して固定されて いたが、霧化ノズル2の位置は、乾燥ガスノズル6の位 置に対して微調整できるものであっても良い。また、乾 燥ガスノズル6は必ずしも細くなくても良い。また、霧 化ノズル2の方向は、サンブリング・オリフィス5に対 して、必ずしも垂直である必要はない。また、筒状ヒー ター1における霧化ノズル2の挿入口は、必ずしも図2 に示すような開放状態である必要はなく、図3に示すよ ろに、閉じられていても良い。また、筒状ヒーター1の 内面形状は、必ずしも円形である必要はなく、たとえば 多面体等でも良く、更に、一部が切り取られて開放され ていても良い。

### [0020]

【発明の効果】以上述べたどとく、本発明にかかる大気 圧化学イオン化イオン源は、霧化室を兼ねた筒状ヒータ - 1の内側に、液体試料を霧化するための霧化ノズル2 を配置すると共に、該霧化ノズル2の先端部から噴出さ 40 れる液体試料の霧滴に対して、加熱された乾燥ガスを乾 燥ガスノズル6から強く吹き付けるようにしたので、霧 化ガスと乾燥ガスがヒーター穴の中で激しくぶつかりあ い、試料液滴の乾燥(脱溶媒化)の効率が格段に向上 し、筒状ヒーター1のパスを従来の1/3以下に短くし ても、むらなく試料液滴を乾燥(脱溶媒化)させること が可能になった。また、乾燥(脱溶媒化)の効率が高い 分、筒状ヒーターの温度を低く設定できるようになり、 試料イオンの熱分解の可能性を最小限度に抑制すること が可能になった。また、バスが短くなったので、試料の (脱溶媒化)が一気に進行する。また、乾燥ガスの導入 50 拡散を低く抑えることができ、効率良く髙感度で質量分 析装置内に試料イオンを引き入れることが可能になった。

## 【図面の簡単な説明】

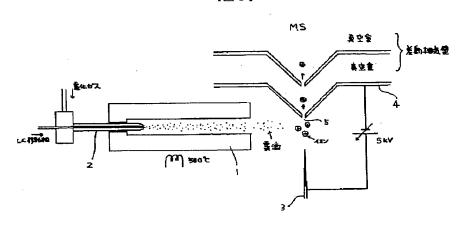
【図1】従来の大気圧化学イオン化イオン源を示す図で ある。

【図2】本発明にかかる大気圧化学イオン化イオン源の 一実施例を示す図である。 \* 【図3】本発明にかかる大気圧化学イオン化イオン源の 別の実施例を示す図である。

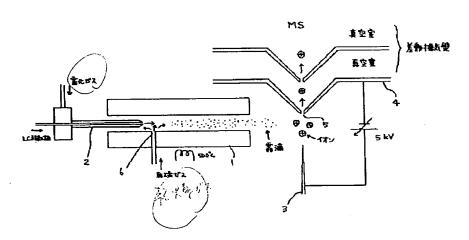
#### 【符号の説明】

1…筒状ヒーター、2…霧化ノズル、3…針状電極、4…対向電極、5…サンプリング・オリフィス、6…乾燥ガスノズル。

【図1】



[図2]



【図3】

